アルミワイヤーハーネスのガルバニック腐食を防止する 防食めっき付き銅端子材の開発

久保田 賢治 玉川 隆士 樽谷 圭栄 中矢 清隆 酒井 章雄 川合 俊輔

Development of Corrosion Protective Plating for Copper Terminal to Prevent Galvanic Corrosion of Aluminum Wire Harness

Kenji KUBOTA Takashi TAMAGAWA Yoshie TARUTANI Kiyotaka NAKAYA Akio SAKAI Shunsuke KAWAI

Abstract

Corrosion protective plating has been developed which greatly prevent galvanic corrosion between aluminum wire and copper terminal of aluminum wire harness. When zinc is added by 2 wt% or more to the tin electrodeposit, the corrosion potential becomes lower than the pitting potential of aluminum, and the aluminum wires can be protected. Corrosion protective plating which supplies zinc from the zinc alloy underplate to the tin surface shows an excellent anticorrosive effect over a long period of time as compared with the electrodeposited Sn-Zn alloy in which the tin phase and the zinc phase are separated. Corrosion current simulation has been carried out for model terminals, indicating that the galvanic corrosion current can be greatly reduced by the corrosion protective plated terminal compared to the copper terminal.

キーワード:アルミワイヤーハーネス、めっき、ガルバニック腐食、アルミ電線、防食

1. はじめに

ワイヤーハーネスの電線を銅(Cu)線からアルミ(Al) 線にすることで軽量化を達成するアルミワイヤーハーネ スが注目されている¹⁾。アルミの比重は 2.7 と銅の 3 分の 1以下であり、導電率が純銅の約半分であることを勘案 しても、銅線をアルミ線に置き換えることで40%以上 の電線軽量化が達成できる。アルミワイヤーハーネスは, 銅合金製の端子とアルミ合金製の電線を加締めて使用す るが、アルミと銅が接続された状態で、塩水などの電解 質水溶液に接触すると、アルミと銅との間でガルバニッ ク腐食が発生する^{2,3)}ことが問題であった。この腐食は非 常に迅速に進行するため、電気接続障害を引き起こす可 能性が高く、アルミワイヤーハーネスを水が浸入する可 能性のある部位に搭載するためには、何らかの防食処理 が必要とされている。従来の防食処理はアルミと銅の接 続部位を樹脂でモールドする方法がとられている2)が. 非常に高いコストがかかっている状況であり、この防食 処理がアルミワイヤーハーネスの採用拡大に対する一つ の障害となっていた。本研究では、銅合金に防食効果を もつめっきを成膜することで、樹脂モールドなどの工数 のかかる防食処理を省略できる防食めっきの開発を目的とした。我々は、電気接点性能が優れる Sn に、腐食電位がアルミよりも卑な Zn を添加することで、端子の腐食電位をアルミに近づけてガルバニック腐食を低減できる点に着目し、Zn 供給源となる Zn 合金層上に Sn めっきを積層し、下地 Zn 合金層から Sn 表面に Zn を逐次供給する下地拡散法防食めっき付き銅端子材料を開発した。

2. 実験方法

2.1 サンプル作製方法とガルバニック腐食性評価

無酸素銅(CDA No.C1020)を基板として、Sn-Zn 合金めっきを $1 \mu m$ 狙いで成膜したものと、無酸素銅板上に、Ni めっき、Zn 合金めっき、Sn めっきを順次積層したものを防食めっきサンプル(CPP)として使用した。Sn-Zn 合金めっき浴はクエン酸を錯体とした浴 3)を使用した。Sn-Zn 合金めっきの亜鉛含有率はめっき浴中の Zn 量を変えることにより $0.6\sim13$ wt%の間で変量した。

Sn 中 の Zn 含 有 率 は Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) によりめっき表面から測定した。無酸素銅板上 に Ni 下地つき Sn めっきを $1 \mu m$ 狙いで成膜したものと 無酸素銅板も、比較用として用意した。これらのサンプ

ルに対して、腐食電位、分極曲線および、Al との間に生じるガルバニック腐食に起因する腐食電流の測定を実施した。腐食電位測定は 23 \mathbb{C} 、5 wt%の NaCl 水溶液中にサンプルを浸漬し、Ag/AgCl 参照極との間の電位差をポテンショメーターにて測定した。

分極曲線は 23^{\circ} の NaCl 水溶液中で、Ag/AgCl 参照極 および Pt 板対極を装備した電解セル中にてポテンショス タットとファンクションジェネレーターを用いて、走査 速度 $1 \, \text{mV/s}$ にて測定した。

腐食電流測定は図1に示す装置を用いて、純AI線と一定面積にマスキングした平板状のサンプルを1 mm の間隔で上下対向して設置し、その間に流れる腐食電流を北斗電工製無抵抗電流計 HM-103 にて測定した。AI線の開口面積は $0.0314~{\rm cm}^2$ とし、平板サンプルの開口面積は $0.283~{\rm cm}^2$ とした。電解液には23 $\mathbb C$ $0.5~{\rm wt}$ %の NaCI 水溶液を用いた。

2.2 腐食電流シミュレーション

腐食電流シミュレーションは図2に示すモデルを使用した。端子サイズは2.3型相当で、線径1.25 sqのAl電線複数本を東ねて加締めた端子が、筐体内に挿入されている形状モデルを作成した。ここでは、複数本のAl電線を1本のAl電線で表現する形状の簡略化を行っている。

本研究では、塩水浸漬時のCu端子とAI電線間で生じるガルバニック腐食をモデルケースとして、腐食電流分布シミュレーション手法を構築した。計算手法は、電解めっきにおける2次電流分布シミュレーション手法^{4.5)}をガルバニック腐食モデルに応用することで開発した。具体的には、液相電位に関する支配方程式としてラプラス方程式を用い、Cu端子面およびAI電線面の境界条件では、境界面での電気化学反応で生じる電荷移動の表面過電圧を考慮に入れている。ここで表面過電圧と電流密度の関係として、本研究では腐食模擬環境での分極曲線測定結果を利用する計算手法を開発した。ガルバニック腐

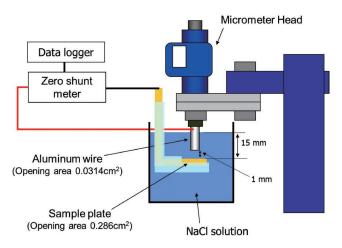


図 1 ガルバニック腐食電流測定の実験装置 Experimental apparatus for galvanic current measurement

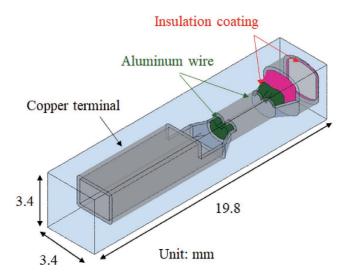


図 2 ガルバニック腐食シミュレーションに用いた端子計算 モデル

Model terminal used for galvanic current simulation

食の進行に伴う、AI 電線の形状変化や Cu 端子表面状態の変化などは考慮に入れず、定常の電場解析および電流分布シミュレーションを実施した。

開発したシミュレーション技術を用い、液温 25℃で 3 wt%の NaCl 水溶液中に筐体ごと浸漬した場合の Cu 端子と Al 電線間で生じるガルバニック腐食を解析した。

3. 実験結果

3.1 ガルバニック腐食性評価結果

図3にSn-Zn合金めっきのZn含有率と、塩水浸漬10分後に示した腐食電位の関係を示す。ここでは、Zn含有率の上昇とともに腐食電位が急激に卑となっている。5 wt%のNaCl水溶液中におけるAlの臨界孔食電位は約-650 mV付近であり、Sn-Zn合金めっきは約2 wt%程度の低い亜鉛量でAlの防食が達成できるものと考えられた。

図4に各サンプルの腐食電位測定結果を示す。Sn-Zn

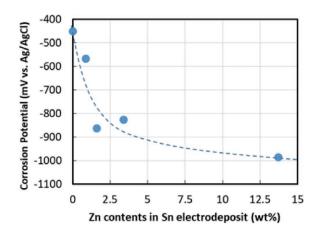


図 3 Sn-Zn 合金めっきの Zn 含有率と腐食電位の関係 Relationship between corrosion potential and Zn content in Sn-Zn electrodeposits

合金めっきは、浸漬直後に-1000 mV 付近の卑な電位を示していたが、500 分を過ぎると腐食電位が急激に上昇して、1300 分後には Sn めっきとほぼ同じ電位にまで達していた。腐食試験前後の Sn-Zn 合金めっき皮膜を Scanning Electron Microscope (SEM) と EPMA で観察したところ、図 $\mathbf{5}(\mathbf{a})$ (\mathbf{b}) (\mathbf{c}) に示すように塩水浸漬前に観察された亜鉛濃縮相が、塩水浸漬 600 分後には図 $\mathbf{5}(\mathbf{d})$ に示すように腐食され穴の生成が確認された。Sn-Zn 合金めっきは Sn 相と Zn 相が明確に分離して析出する $\mathbf{6}^{6,7}$ ため、表面に露出している Zn 相に腐食電流が集中し、電位を卑化するために必要な Zn が早期に失われてしまっ

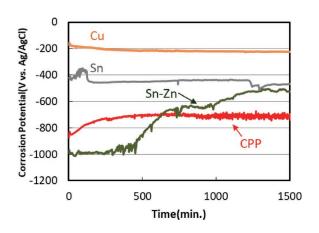


図 4 各サンプルの腐食電位測定結果 Corrosion potential time change of each samples Cu: C1020 plate, Sn: Tin plated copper,

Sn-Zn: Sn-Zn(Zn 13 wt%) plated copper CPP: Corrosion protective plated copper

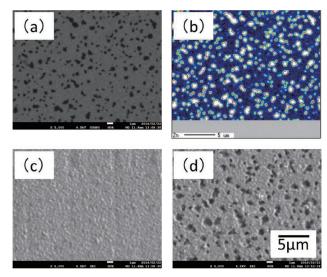


図5 腐食試験前後のSn-Zn 合金めっき皮膜のSEM と EPMA の観察結果

SEM and EPMA images of Sn-Zn plated copper surface (a): SEM reflected electron image. (b): EPMA zinc mapping image. (c): Secondary electron image before immersion in salt water. (d) Secondary electron image after immersion in salt water

たものと考えられた。

一方、 \mathbf{Z} 4の防食めっきサンプルでは 1500 分にわたって、 $-700~\mathrm{mV}$ 付近のほぽ一定の腐食電位を示していた。防食めっきサンプルの断面を Auger electron spectroscopy (AES) と SEM で観察したところ、 \mathbf{Z} 6 に示すように Snの結晶粒界を通じて、下地層である \mathbf{Z} 7 合金層から \mathbf{Z} 7 が Sn表面へと拡散していることが確認された。

Al とのガルバニック腐食を防止するために必要な Zn 量は、Sn に対して数 wt%という少量であるため、Sn 結晶粒界を通じた Zn の供給でも十分な防食効果が発揮され、一方で、Sn 層の存在が Zn の過剰な溶出を防止するために長時間にわたり卑な腐食電位を維持できたものと考えられた。

図7に各サンプルをAI線と接続した際に流れるガルバニック腐食による腐食電流測定結果を示す。ここでは、Cu は初期に $30~\mu$ A を超える電流が流れていたが、次第に低下し、 $12~\mu$ A 程度の電流値で安定した。Sn めっきサンプルでは極初期は $1~\mu$ A 程度と非常に電流値が低かったが、その後急激に上昇し $8\sim 9~\mu$ A 程度の電流値を示した。これに対して、Sn-Zn 合金めっきは $800~\gamma$ 付近まで腐食電流が非常に低かったが、その後上昇傾向を見せた。Sn-Zn 合金めっきの腐食電流が上昇するタイミングが図4の腐食電位が上昇しきった時点にほぼ一致している。これは Zn 相の腐食損耗により、Sn-Zn 合金めっき表面の電位が AI の孔食電位よりも貴となり、防食効果が弱まって腐食電流が流れるようになったものと考えられる。一方、下地拡散法の防食めっきは $1~\mu$ A 以下の非常に低い電流が

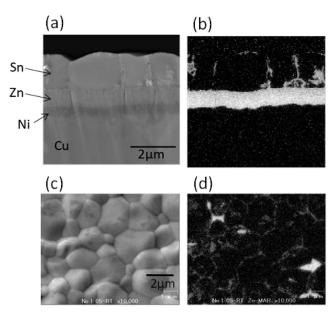


図 6 防食めっきサンプルの表面および断面 AES と SEM の

SEM image and AES composition map of the Tin plated copper with zinc underplate sample. (a) Cross sectional SEM image. (b) Cross sectional AES zinc mapping image. (c) Surface SEM image. (d) Surface AES zinc mapping image

1500 分間にわたって観測されるのみであり、高い防食性能を長時間にわたって維持できることが期待された。

各サンプルと AI のガルバニック腐食のメカニズムについて詳細に調査するために分極曲線の測定を実施した。 図 8 に各サンプルの分極曲線測定結果を示す。 AI についてはアノード分極曲線のみ記載しており、その腐食電位は - 700 mV 付近であるが、 AI の溶出に伴うアノード電流が急激に立ち上がる孔食電位は - 650 mV 付近であった。

AIに対してカソードとなり腐食電池を形成する可能性があるCu, Sn, CPPについてはカソードとアノード分極曲線の両方を測定している。AIのガルバニック腐食速度は分極曲線から概略の予測が可能である。ガルバニック腐食は速度と腐食発生時の電位は、AIと貴な金属の面積比が同一であり、電解質水溶液の溶液抵抗の影響を無視した場合、図8におけるAIのアノード分極曲線と貴な金

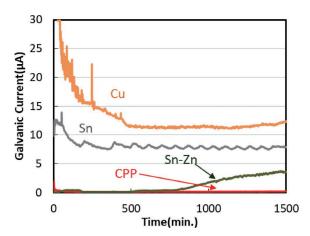


図 7 各サンプルのガルバニック腐食腐食電流の測定結果 Galvanic current time change of each samples

Cu: C1020 plate, Sn: Tin plated copper, Sn-Zn: Sn-Zn(Zn 13 wt%) plated copper CPP: Corrosion protective plated copper

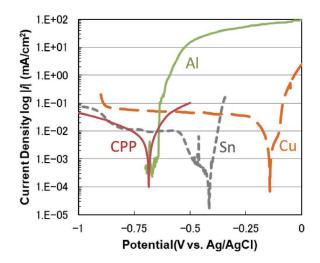


図 8 各サンプルの 3 wt% NaCl における分極曲線測定結果 Polarization curves of each samples in 3 wt% NaCl

属のカソード分極曲線の交点で進行すると考えることができる。例えば Cu と Al の関係に着目すると、交点は電位が-636 mV であり、Cu と Al の面積比が 1:1 の場合の腐食電流密度は 62 $\mu A/cm^2$ と見積もられた。

Cuの分極曲線について着目すると腐食電位が-150~mV付近であり、-250~mVよりも貴な電位で一定のカソード電流を示している。分極曲線で示されているカソード電流は、Cu上で起こる溶存酸素の還元電流に起因する電流値であり、これが電位に依存せずに一定値を示していることから、既報 8)で報告されているとおり、Cu表面におけるカソード反応は溶存酸素の拡散過程が律速となっていることが確認できる。

Sn と Al の関係については、Al アノード分極曲線と Sn のカソード分極曲線の交点は電位が -646 mV であり、腐食電流密度は $11 \, \mu A/cm^2$ であった。このように Sn と Al の間にもガルバニック腐食が発生することが示されている。一方、防食めっきは腐食電位が -680 mV 付近と、Al の孔食電位よりも卑であり、防食めっきのカソード分極曲線と Al のアノード分極曲線との交点は、電位が -683 mV、腐食電流密度は $0.3 \, \mu A/cm^2$ であった。このように、防食めっきと Al の間に流れる腐食電流は Cu のそれと比較すると極めて低くなることが分極曲線から示唆される結果となった。

3.2 腐食電流シミュレーション

実際に自動車で用いられているアルミワイヤーハーネ スでは、Cu端子とAI電線露出面の面積比は1:1ではな く, Cu端子表面の面積の方が大きい。例えば, 図2に示 すモデル端子の場合、Cu端子の表面積はAl電線露出面 積の約50倍となる。このように実際に用いられている端 子の腐食現象を評価するためには、異種金属の面積比を 考慮に入れる必要がある。本腐食電流シミュレーション では、この面積比の影響を考慮に入れた上で、図8に示 される分極曲線上で、Al 電線の腐食アノード電流と Cu 端子面でのカソード電流がバランスする電位位置を追跡 しながら電場解析を実施している。Alの分極挙動につい て、実測でみられる腐食電位と孔食電位間の振動挙動を 考慮に入れると、腐食電流シミュレーションの収束性を 著しく低下したため、振動挙動を除去する補正を行った 分極曲線をAI電線の境界条件に用いた。図9にAI電線 の腐食電流分布シミュレーション結果を示す。ここでは. Cu端子面に防食めっき処理をした場合と、そのままの Cu 端子面の場合の Al 電線の腐食電流密度分布を示して いる。

Cu 端子と Al 電線のガルバニック腐食の場合 (図9(a)), Cu 端子の表面積が Al 露出面積の約 50 倍であることを考慮すると, Cu 面でのカソード電流と Al 面でのアノード電流が一致するのは, -570 mV 付近であるとシミュレーション示唆された。また, バレル端部とバレル

間の2箇所のAI電線露出部では、バレル端部の方が、AI腐食電流密度が大きくなるものと予測された。これは、 筐体内の塩水中で生じるCu端子とAI電線との間の電流線を可視化することで、考察できる。Cu端子とAI電線のガルバニック腐食の場合の、電流線の可視化結果を図10に示す。加締め部付近の、厚い塩水領域が生じる箇所で、一部の電流線はバレル間のAI露出部とつながり、残りの大部分の電流線はバレル端部のAI露出部とつながることが可視化されている。このように、銅端子の形状や、AI電線に対する面積比以外にも、端子を挿入する筐体のサイズや形状も、AI電線の腐食速度に影響を与え、本シミュレーション技術でそれを予測できることが示されている。

防食めっき処理された Cu 端子と AI 電線のガルバニック腐食の場合(図 9(b))は、ガルバニック腐食が-695 mV 付近で進行するとシミュレーション示唆された。防食めっき処理によって、バレル端部の AI 電線の平均腐食電流密度は、2.62 mA/cm² から 0.53 μ A/cm² まで低減し、防食めっき処理によってガルバニック腐食に起因する腐食電流が大幅に削減されることが示唆される結果となった。

4. 考 察

以上の実験結果より、銅板上に、Ni めっき、Zn 合金 めっき、Sn めっきを順次積層した防食めっきは、Sn-Zn 合金めっきと比較して、めっき表面の腐食電位を長時間 にわたり卑に保つ能力を有することが明らかになった。 また. 別報 9 では Sn と Zn をリフロー処理により合金化 して Sn めっき中に Zn を添加する手法よりも、本報の防 食めっきの方が電位を卑に保つ効果が持続すること優れ ていることも示されている。ここで、防食めっきの電位 卑化効果が継続するメカニズムについて考察する。Sn めっき表面に存在する Zn には、Sn と Zn の腐食電位の差 から、Sn上で起こる溶存酸素の還元反応に起因するア ノード電流が流れ込み Zn を溶解していく。このアノー ド電流は、Sn と Zn の表面露出比と Sn 表面の還元反応活 性10) により決定され、Sn-Zn 合金めっきでは表面に明確 な穴を形成するほど電流が Zn 部に集中して流れている。 防食めっきの Zn は図6に示されているように、Sn 結晶 粒界に濃集しており、ZnがSnめっき表面に存在してい る面積はSn-Zn合金めっきと比較するとむしろ狭いもの と考えられる。とすると、防食めっきでは粒界に存在す

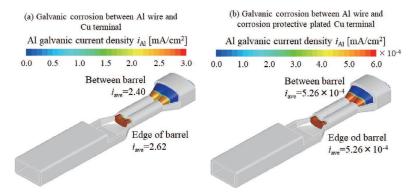


図 9 Al 電線内のガルバニック腐食電流密度分布の計算結果 Calculated galvanic current density distribution on Al wire

(a): Galvanic corrosion between Al wire and Cu terminal.

(b): Galvanic corrosion between Al wire and corrosion protective plated Cu terminal.

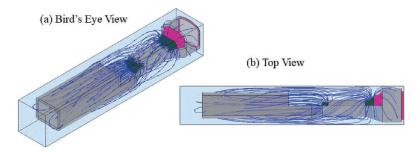


図 10 ガルバニック腐食中の Al 電線と Cu 端子間の電流線の可視化結果 Visualization result of electric current flow between Al wire and Cu terminal during galvanic corrosion

(a): Bird's eye view. (b): Side view.

る Zn には高い電流密度の腐食電流が流れる可能性が高く、Sn-Zn 合金めっきよりもさらに短期間に Zn が枯渇すると考える方が自然であろう。

防食めっきが長時間にわたり電位を卑に保っているという実験事実から、本層構成では、腐食により失われた Zn が、Sn 粒界を通じて下層から次々に供給されているものと考えられる。しかしながら、23℃という低温において腐食電位を維持できるほどの量の Zn が固体中を拡散により速やかに移動し得るのであろうか。

ヒントを与えてくれる事例として Si-Au 系¹¹⁾ がある。本系では清浄な Si 上に Au を蒸着すると、室温 1~2 週間程度で Au 上に Si が拡散し Au 表面に Si 酸化膜が形成することが知られており、InP-Cu 系でも同様の現象が認められている¹²⁾。このように単純共晶系の 2 つの元素を接触させると、その界面では共晶温度以下で相互拡散が発生し、そこでは非常に迅速な原子の拡散が起きる元素の組み合わせがあることを示している。防食めっきにおいても、Sn-Zn 界面と Sn 粒界内でこのような、相互拡散層の形成が起こり、Zn が液相のごとく迅速に移動している可能性があるものと考えている。以上のように、本報で報告した防食めっきの防食性能発現機構は、広く知られていない特殊な拡散現象に依るものと考えられる。このような粒界拡散現象は非常に興味深く、今後研究を進めていきたい。

5. まとめ

アルミワイヤーハーネスの AI 電線と Cu 端子の間に発生する、ガルバニック腐食をめっきにより防止することを目的として検討を行った。その結果、接点性能に優れる Sn に 2 wt%以上の Zn を添加すると、Sn めっきの腐食電位が AI の孔食電位よりも卑となり、めっきに防食効果が発現することを明らかとした。 Sn と Zn の合金化手法として、電析によるものと、Sn 層下地の Zn 層から Zn を供給する方法を比較した。その結果、電析 Sn では Zn の濃縮相が早期に溶出してしまうため、電位を卑に保つ効果が長時間持続しなかったが、Sn 層下地の Zn 層から Zn を供給する方法では、Sn の結晶粒界を通じて Zn が逐次供給されるため、Zn の過剰な腐食を抑制し、長時間にわたって防食効果が持続することが分かった。本系の Sn 粒界中の Zn 拡散は非常に速く、通常の固体拡散とは異なる特殊な拡散現象が起きている可能性がある。

以上の基礎的検討から、Sn層下地のZn層からZnを供給する手法をCu合金のめっきに応用し、Cu端子上にNi,Zn合金、Snを順次積層した防食めっきの開発に至った。この防食めっきを施したCu合金端子材はAlとの腐食電流を大幅に低減することが可能であり、2.3型端子を模擬した腐食電流シミュレーションにおいてもアルミ線に流れる腐食電流を、銅合金端子に対して、1000分の1以下にまで低減できることが予想された。

本研究で開発された防食めっきを用いることで、従来から用いられている樹脂モールド処理などの追加の防食処理が不要となり、アルミワイヤーハーネスの小型化と低コスト化に貢献できるものと期待される。

文 献

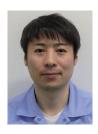
- 1) 田口欣司,嶋田高信,吉本 潤,桑原鉄也,赤祖父 保広, "エンジンの振動屈曲に耐える高強度アルミ ワイヤーハーネス", SEIテクニカルレビュー, **190**, 117-122 (2017).
- 2) 山野能章, 細川武広, 平井宏樹, 小野純一, 大塚拓次, 田端正明, 大塚保之, 西川太一郎, 北村真一, 吉本 潤, "アルミハーネスの開発", SEI テクニカルレビュー, **179**, 81-88 (2011).
- 3) 芦田哲哉,磯野重樹,小崎高明,"自動車用アルミ電線の端子接続技術の開発",三菱電線工業時報, 103,23-26 (2006).
- 4) 小原勝彦, "電解槽の電流分布解析の実際", 表面技術, 64, 537-542 (2013).
- A. D. Kinga, J. S. Lee and J. R. Scully, "Finite Element Analysis of the Galvanic Couple Current and Potential Distribution between Mg and 2024-T351 in a Mg Rich Primer Configuration", *Journal of the Electrochemical* Society, 163, C342-C356 (2016).
- 6) Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Aldona Jaowiec and Remigiusz Kowalik, "Tin-zinc alloy electrodeposition from aqueous citrate baths", *Surface & Coatings Technology*, **240**, 311-319 (2014).
- 7) 土肥信康,小幡恵吾,"グルコン酸塩浴からのスズ -亜鉛合金電着物の性質",金属表面技術,**25**, 14-20 (1974).
- 8) 王 栄光, 長野博夫, "NaCl 水溶液による Al/Cu の ガルバニック腐食挙動", 材料と環境, **60**, 22-27 (2011).
- 9) 久保田賢治, 玉川隆士, 西村 透, 樽谷圭栄, 中矢 清隆, "表面処理による銅端子とアルミ電線の間に 生じるガルバニック腐食の防止", 銅と銅合金, **59**, 184-188 (2020).
- 10) 新井宏忠, 石橋 龍, 松本克才, 久保田賢治, "塩 化ナトリウム水溶液中における Cu-Al および Sn-Al のガルバニック腐食挙動", 銅と銅合金, **58**, 319-322 (2019).
- 11) 平木昭夫, 岩見基弘, "金属と半導体の反応 Au-Si 系を中心として", 日本金属学会会報, **15**, 665-673 (1976)
- 12) 平木昭夫, 岩見基弘, "金属-半導体界面の合金化", 日本金属学会会報, **19**, 333-339 (1980).



久保田 賢治 Kenji KUBOTA めっきプロセス領域 主任研究員 博士 (工 学)



中矢 清隆 Kiyotaka NAKAYA めっきプロセス領域 主任研究員



玉川 隆士 Takashi TAMAGAWA 高機能製品カンパニー若松製作所技術部生産技 術課



酒井 章雄 Akio SAKAI CAE 領域 研究員 博士(理学)



樽谷 圭栄 Yoshie TARUTANI めっきプロセス領域 専任研究員



川合 俊輔 Shunsuke KAWAI CAE 領域 専任研究員 博士 (工学)